

DIN Normenausschuß Feinmechanik und Optik; AA O3 Dünne Schichten für die Optik

- keine neuen Informationen -

VDI-Gesellschaft Produktionstechnik; Richtlinien-Fachausschuß

- keine neuen Informationen -

VDI-W : VDI-Richtlinie # 3823 „Qualitätssicherung bei der Vakuumbeschichtung von Kunststoffen“

- keine neuen Informationen -

VDI/VDE-GMA-Fachausschuß FG 3.40 „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“

VDI/VDE GMA Aussprachetag „Metrologie in der Mikro- und Nanotechnik“
 Termin wurde verschoben auf Frühjahr 2003, Stuttgart

DIN NMP 141 Härteprüfung : ISO/DIS 14577 Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters

- keine neuen Informationen -

ISO/TC 201 Oberflächenanalytik : Aktueller Stand

Organisation des ISO/TC 201:

- 8 Subkomitees und 1 Arbeitsgruppe
- 30 Länder sind durch ihre nationalen Standardisierungsorganisationen vertreten
- hiervon sind 10 Länder "participating members" (China, Italien, Japan, Rep. Korea, Österreich, Russische Föderation, Schweiz, Slowenien, UK, USA).
- Weitere 20 Länder (u.a. Deutschland) haben einen Beobachterstatus.

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 201:

Aktuelles Arbeitsprogramm des ISO/TC 201 (Stand: 2001-11-07):

Itm. No.	SC	WG	Crnt. Stage	Ref. No. Reg. Date	Title / Convenor or Project leader (SCA: Surface chemical analysis)
1		2	CD	17331 2000-02	SCA - Chemical preparation methods to collect analyte elements of working reference material of silicon wafers for TXRF / Dr.Y.Gohshi
2	2	1	AWI	18116 2000-01-04	SCA - Preparation and mounting of specimens for analysis / Dr.W.F.Stickle
3			AWI	18117 2000-01-04	SCA - Handling of specimens prior to analysis / Dr.W.F.Stickle
4		2	AWI	16268 2000-01-04	Ion-implanted surface analytical reference materials: Procedure for standardizing the retained areic dose in a working reference material / Dr.W.Gries
5		3	NP	(16243)	Reporting of surface analytical data a) X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) - Spectra / Dr.S.J.Harris
6			NP	(16242)	Reporting of surface analytical data b) Auger electron spectroscopy (AES) - Spectra / Dr.S.J.Harris
7	3	1	WD	22048 2000-09-25	SCA-Information format-Static secondary ion mass spectrometry / Dr. M.P.Seah
8			NP	(15760)	SCA-Data dictionary for the description of X-ray photoelectron and Auger electron spectroscopy data records / Dr. D.A.Gaarenstroom
9			NP	22474 2001-09-10	SCA - Peak detection methods to perform qualitative or quantitative analysis in X-ray photoelectron or Auger electron spectroscopy / Dr. Yoichiro Furukawa
10	4	1	NP	22335 2001-07-23	SCA - Depth profiling - Measurement of sputtering rate mesh-replica method with the use of mechanical stylus profiler / Dr.M.Suzuki
11	5	1	WD	18118 1997-12-01	AES and XPS - Guidelines to the use of experimental relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials / Dr.C.J.Powell
12			WD	20903 2000-12-13	SCA - Peak intensity determination in AES and XPS - Direct spectra / Dr.C.J.Powell
13			CD	19318	SCA - X-ray photoelectron spectroscopy - Reporting of methods used for

				2000-07-25	charge control and charge correction / Dr.C.J.Powell
14		WD		19319 2000-08-08	SCA - AES and XPS - Determination of the sample area contributing to the detected signal / Dr.C.J.Powell
15	6	1	PRF	17560 1998-10-08	SCA - Secondary ion mass spectrometry - Method for depth profiling of boron in silicon / Dr.Y.Homma
16		2	CD	18114 1999-02-01	SCA - Secondary ion mass spectrometry - Determination of relative sensitivity factors from ion-implanted reference materials / Dr.D.S.Simons
17		3	CD	20341 2000-04-24	SCA - Secondary ion mass spectrometry - Method for estimating depth resolutions with delta multi-layer reference materials / Dr.Dae Won Moon
18	7	1	DIS	15470 1997-04-15	SCA - X-ray photoelectron spectroscopy - Description of selected instrumental performance parameters / Prof.J.F.Watts
19			DIS	15471 1996-07-15	SCA - Auger electron spectroscopy - Description of selected instrumental performance parameters / Prof.J.F.Watts
20		2	FDIS	17973 1999-11-24	SCA - Medium resolution Auger electron spectrometers - Calibration of energy scales for elemental analysis / Dr. M.P.Seah
21			FDIS	17974 1999-11-24	SCA - High resolution Auger electron spectrometers - Calibration of energy scales for elemental and chemical state analysis / Dr. M.P.Seah
22			AWI	21270 2001-04-04	SCA - X-ray photoelectron and auger electron spectrometers - Linearity of intensity scale / Dr. M.P.Seah
23		3	CD	18327 1999-11-03	SCA - X-ray photoelectron spectroscopy - Guidelines for estimating unintended degradation in a material / Dr.B.V.Crist
24	8	1	WD	16962 1999-07-01	Determination of thickness and chemical composition of Zn and/or Al based metallic coatings by GDOES / Dr.A.Bengtson

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

ISO/TC 202 : AktuellerStand

Organisation des ISO/TC 202:

- 5 Subcommittees mit Arbeitsgruppen sowie eine weitere Arbeitsgruppe, die direkt dem TC Sekretariat unterstellt sind.
- Web-Seite zur Information über die ISO TC202-Aktivitäten:
www.msa.microscopy.com/ISO/

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 202:

Status der Normenentwicklung durch ISO/TC 202:

Nr	Inhalt der Norm	Status
ISO 15632	Spezifikationen für energiedispersive Röntgenspektrometer	FDIS (50.00)
ISO 16700	Vorschrift zur Kalibrierung der Vergrößerung am REM	CD (30.20)
ISO 22029	EMSA/MAS Standard file format for spectral data exchange	DIS (40.60)
ISO 14594	Testmethoden für Elektronenstrahl-Mikrosonden	CD (30.99)
ISO 15595	Anforderungen an ein CRM für die Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.99)
ISO 17470	Vorschrift zur qualitativen Elektronenstrahl-Mikroanalyse	CD (30.20)
ISO 22489	Anleitung zur quantitativen Punktanalyse bei der ESMA	NP (10.20)
ISO 22309	Anleitung zur quantitativen Analyse mittels EDX	WD (20.20)
ISO 17270	Vorschrift zur Durchführung der ELS am STEM	AWI (20.00)
ISO 23833	Vokabular	CD (30.20)

Weitere Informationen zum laufenden Arbeitsprogramm sind verfügbar unter :

http://www.bam.de/kompetenzen/arbeitsgebiete/abteilung_8/fachgruppe_82/laboratorium_823.htm

gez. G. Reiners

Tel.: 030/8104-1820; FAX: -1827, Email: georg.reiners@bam.de,

<http://www.bam.de/fg-82.htm>